

Загрузка оборудования ЦКП "Спектроскопия и оптика" на 2023 г.

		- оборудование доступно					- занято					- недоступно в связи с отпуском оператора					- в ремонте или на модернизации					- каникулы																																						
		март					апрель					май					июнь					июль					август					сентябрь					октябрь					ноябрь					декабрь													
Число рабочих дней в неделе		3	5	5	5	5	0	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	5	5	5	5	0	5	5	5	5	1	4	5	5	5	4	1	5	5	5	5	0	5	5	5	5	2	3	5	5	5	4	1	5	5	5	5							
	Понедельник	5	12	19	26		3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31		7	14	21	28		4	11	18	25		2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18	25		2	9	16	23	30				
	Вторник	6	13	20	27		4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18	25		2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18	25		2	9	16	23	30	6	13	20	27		4	11	18	25		2	9	16	23	30
	Среда	1	7	14	21	28	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28		5	12	19	26		3	10	17	24	31	6	13	20	27		4	11	18	25		1	8	15	22	29	6	13	20	27		4	11	18	25		2	9	16	23	30
	Четверг	2	8	15	22	29	6	13	20	27	4	11	18	25		1	8	15	22	29	6	13	20	27		3	10	17	24	31	7	14	21	28		5	12	19	26		2	9	16	23	30	7	14	21	28		5	12	19	26		3	10	17	24	31
	Пятница	3	9	16	23	30	7	14	21	28	5	12	19	26		2	9	16	23	30	7	14	21	28		4	11	18	25		1	8	15	22	29	6	13	20	27		3	10	17	24	31	5	12	19	26		3	10	17	24	31					
	Суббота	4	10	17	24	31	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30														
	Воскресенье	5	11	18	25		2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31	1	8	15	22	29	5	12	19	26		3	10	17	24	31												
		648 42% Процент загрузки ЦКП																																																										
1	Комплекс источников лазерного излучения: Генератор фемтосекундного излучения накачки TERA ATsG (Авеста-проект); Система мультиспектральной синхронной генерации фемтосекундных лазерных импульсов (Фемтоника); Система синхронной регистрации электромагнитного излучения в различных диапазонах (Авеста); Диодная лазерная система TEC 520-1950-020 (Lion) с перестройкой по длине волны излучения в диапазоне 1825-1940 нм	3	5	5	5	5	0	1	5	0	1	3	2	0	0	3	2	1	2	3	1	0	0	5	5	1	4	5	5	5	4	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0									
2	Гибридный комплекс прецизионной лазерной 3D печати в составе: Одномодовый волоконный лазер 500 Вт MFS-500W-LLS (Maxphotonics), Фемтосекундный лазер PHAROS PH1-20 (Light Conversion), Система прецизионной 3D печати (ИАиЭ СО РАН), Высокоразрешающий тепловизор (Fluke)	3	5	0	0	0	0	0	4	3	2	5	5	5	0	0	1	1	2	3	2	0	0	5	0	5	1	4	5	5	5	4	1	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Комплекс для измерения параметров излучения: Измеритель длин волн лазерного излучения WS-5VISIR (Ангстрем); Измеритель мощности лазерного излучения Nova II PD300 (Orphir Photonics); Цифровая система многоканальной регистрации спектра с CCD-камерой Spec-10 System (Princeton Instruments)	3	5	5	5	5	0	2	5	2	1	3	2	0	0	3	0	1	2	3	3	0	0	5	0	5	1	4	5	5	5	4	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	Комплекс для спектроскопических исследований методами УФ-, видимой, ИК-, терагерцовой, КР-спектроскопии, в том числе спектрального микрокартирования: Двухканальный спектрофотометр UV-2501 (Shimadzu); Спектрометр ИК-Фурье Vertex 80V (Bruker); Спектрофлюориметр Cary Eclipse (Agilent Technologies); Малогабаритный широкополосный терагерцовый спектрометр (ИАиЭ СО РАН); Система нестационарной терагерцовой спектроскопии на основе титан-сапфирового лазера с многопроходным усилителем (ИАиЭ СО РАН); Терагерцовая лазерная спектроскопическая платформа TERASCAN1550 (Toptica); Тройной Рамановский спектрометр TR777AS (Princeton Instruments) в комплекте с лазерами Quantum Torus и Cobolt Flamenco; Спектрометр TFP-1 (JRS Scientific Instruments) в комплекте с источником излучения EXLSR-532-200-CD; Лабораторный микроскоп проходящего света BX43 (Olympus)	3	5	5	5	5	0	3	5	3	2	3	2	0	0	3	2	1	1	3	4	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		75 42%																																																										

5	<p>Комплекс оборудования для обработки оптического волокна, создания и исследования оптоволоконных компонентов: Лабораторный сварочный аппарат оптического волокна FSM-100P (Fujikura); Система для сварки и обработки оптического волокна LZM-100(Fujikura); Станция вытяжки оптического волокна/ответвителей CW-200B (Lightel); Сварочный аппарат и восстановитель защитного покрытия оптического волокна FSM-17S и FSR-02 (Fujikura); Рефлектометр высокого разрешения OBR 4600 (Luna Innovations); Анализатор оптического спектра (0,6–1,6 мкм) с источником белого света и измерителем мощности (до 30 Вт) AQ6370 (Yokogawa)</p>	3	5	5	5	5	0	4	5	4	4	0	3	2	0	0	0	3	2	1	1	3	5	0	0	5	5	0	1	4	5	5	5	4	1	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	42%
6	<p>Комплекс оборудования для микроструктурирования, модификации и анализа топологии и состава поверхности оптических материалов: Установка для прецизионного магнетронного осаждения металлов ATC-Z200H (AJA); Установка осаждения покрытий VSE-PVD-100-2 (Вакуумные системы и электроника с оптической системой контроля Колибри-2 (ВМК "Оптоэлектроника"); Установка лазерной безмасковой фотолитографии DWL 66+Hires (Heidelberg); Круговая лазерная записывающая система ЛФП CLWS-300IAE (ИАиЭ СО РАН); Стенд для лазерной литографии X-Y ЛНЛ (ИАиЭ СО РАН); Установка реактивного ионного травления Plasmalab 80 Plus (Oxford Instruments); Лазерный интерферометр ФИЗО ФТИ-100PS-GbE-R (ИАиЭ СО РАН); Прибор для определения профиля поверхности на микро- и нано- масштабах (АСМ) с системой плазменной подготовки поверхности образцов; Атомно-силовой ближнепольный микроскоп Multi View 2000 (Nanonics); Спектральный эллипсометр Спектроскан (ИФП СО РАН); Микроскоп биологический лазерный сканирующий LSM 700 (Zeiss); Микроскоп оптический DM IRB (Leica); Микроскоп сканирующий электронный TM-3000 (Hitachi)</p>	3	5	5	5	5	0	3	5	5	0	3	2	0	0	0	3	2	1	1	3	4	0	0	5	5	0	1	4	5	5	5	4	1	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99	42%
7	<p>Прибор для измерения показателя преломления, толщины слоев оптических структур на различных длинах волн: призмазная измерительная система Metricon Model 2010/M</p>	3	5	5	5	5	0	2	5	4	0	3	5	0	0	0	3	2	1	0	3	3	0	0	5	5	5	1	4	5	5	5	4	1	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	42%

